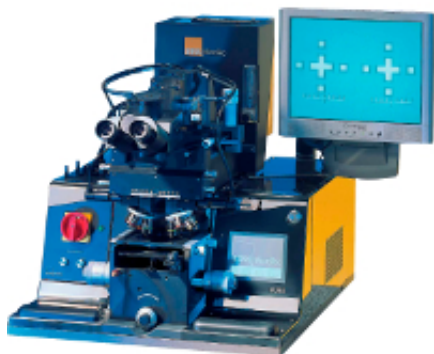


Ручная установка совмещения и экспонирования SUSS MJB4



Ручная установка совмещения и экспонирования для контактной литографии базового уровня. Обработка пластин до 100 мм

Страна производитель: Германия

Основные возможности:

- ✓ Экспонирование высокого разрешения – до 0,5 микрон
- ✓ Размер обработки пластин и подложек - до 100 мм диаметром (пластины) и до 100x100 мм (подложки).
- ✓ Специальные держатели для кусков пластин, A3-B5, толстых подложек, гибридных схем и ВЧ
- ✓ Высокоточная юстировка на плоскости и манипулятора микроскопа
- ✓ Возможность конфигураций оптики интенсивной УФ и экспозиций с длиной волны до 80 мВт/см²
- ✓ Минимальные затраты на обучение операторов установки
- ✓ Продуманная эргономика
- ✓ Графический интерфейс пользователя управляет функциями установки со специального экрана, чувствительного к нажатиям
- ✓ Легкий доступ ко всем элементам установки
- ✓ При необходимости устанавливается лазерное оборудование

Инжиниринговые услуги:

- ⚙ Системы виброзащиты оборудования